DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03192798 A

PAT-NO:

JP403192798A

DOCUMENT-

JP 03192798 A

IDENTIFIER:

TITLE:

WATER-COOLED HEAT

SINK

**PUBN-DATE:** 

August 22, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MISHIRO, MASAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD N/A

**APPL-NO:** JP01331033

APPL-DATE: December 22, 1989

INT-CL (IPC): H05K007/14 , H01L023/34

US-CL-CURRENT: 257/714 , 361/699

# ABSTRACT:

PURPOSE: To control pH of cooling water and remove anions to prevent corrosion of

metal material before it reaches the heat releasing part of an electronic device by providing a pH sensor, an anion exchanger, and a control unit which controls solenoid valves.

CONSTITUTION: A pH sensor 11 which measures pH of a cooling water, an anion exchanger 10 which exchanges ions of cooling water, and a control unit 15 which controls solenoid valves 12a and 12b which switch the path of cooling water based on the measurement of the pH sensor 11 are provided. Therefore, pH or corrosive anions which mainly corrode the metal material in the circulating path of a cooling device are always monitored, and if abnormality is detected, acid is adsorbed by an anion exchanger. By this setup, cooling water can be automatically controlled in quality.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

# 1/2

# ⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# @ 公開特許公報(A)

平3-192798

@int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月22日

H 05 K 7/14 H 01 L 23/34 P 7301-5E 7220-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称 水冷式冷却装置

②特 願 平1-331033

②出 願 平1(1989)12月22日

**@発明者 御代** 

抽 地太

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 大野 隆男 外1名

明細数

1. 発明の名称

水冷式冷却装置

# 2. 特許請求の範囲

冷却水を循環経路 (6) を介して循環して電子 機器発熱部 (A) を強制水冷する水冷式冷却装置 において、

合却水のPHを測定するPHセンサ(11)と、 該冷却水のイオン交換を行う陰イオン交換器 (10)と、

該 P H センサ (11) の測定値に基づいて該冷 却水の水路を切り替えるソレノイド弁 (12a. 12b) を制御する制御ユニット (15) と、 を有することを特徴とする水冷式冷却装置。

# 3. 発明の詳細な説明

#### (概要)

プリント板の集積回路素子等の発熱部を強制冷 却する水冷式冷却装置に関し、 冷却装置の金属材料部分の腐食に関与するPH または腐食性アニオンを電子機器発熱部に到達す る前に調整・除去することを目的とし、

冷却水を循環経路を介して循環して電子機器発 熱部を強制水冷する水冷式冷却装置において、冷 却水のPHを測定するPHセンサと、該冷却水の イオン交換を行う陰イオン交換器と、該PHセン サの測定値に基づいて該冷却水の水路を切り替え るソレノイド弁を制御する制御ユニットとからな るよう構成される。

# 〔産業上の利用分野〕

本発明は、プリント板の集積回路素子等の発熱 部を強制冷却する水冷式冷却装置に関するもので ある。

### 〔従来の技術〕

従来の水冷式冷却システムは、第2図に示されるように、冷却水が所定量貯蓄されたタンク 7 と、 タンク 7 から網もしくは網合金から構成された循

FP04-0253-

08 2 19



# 特閒平3-192798 (2)

環経路6を介して冷却水を所定量吐き出すポンプ 8と、この冷却水を所定温度まで冷却する熱交換 器9から構成されていた。

そして、冷却した冷却水を冷却プレート3内の循環路4に循環して、電子機器発熱部Aである冷却プレート3の所定位置から突出してなるベローズ5に対応して基板1上に実装される素子2の冷却を行っていた。

冷却を行った後の冷却水は再度タンクに戻され 終始循環していた。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、従来の水冷式冷却装置においては、特に水質(特にPHや腐食性アニオンC 2 · · SO.\* · 等)を自動的に維持コントロールする機能は有していなかった。

つまり、冷却水は一般に市販の蒸留水(イオン 交換水)である純水が使用されるが、装置稼働中 に大気開放のタンクから大気中の炭酸ガスで冷却 水が弱酸性 (PH4~6)になったり、大気中の

して電子機器発熱部Aを強制水冷する水冷式冷却 装置において、

冷却水のPHを測定するPHセンサ11と、 該冷却水のイオン交換を行う除イオン交換器 10と、

抜 P H センサ 1 1 の 測定値に基づいて 抜 冷却水の水路を切り替えるソレノイド 弁 1 2 a. 1 2 b を制御する制御ユニット 1 5 と、

を有することを特徴とする水冷式冷却装置、に より達成される。

#### (作用)

上記の如く構成された本発明の水冷式冷却装置 においては、常時、循環経路中の冷却装置の金属 材料部分を腐食する源であるPHまたは腐食性ア ニオンを監視し、異常が検出されると陰イオン交 換器により酸の吸着を行うため、水質を自動的に 維持コントロールすることが可能となる。 塩素ガスや亜硫酸ガスが冷却水中に溶解し、C ℓ-やSO4<sup>2-</sup> の濃度が増加する。

通常、上記冷却装置を構成する循環経路等は調むしくは網合金で構成されていることから、この網もしくは網合金の腐食はPHに依存しやすく、弱アルカリ領域では優れた耐食性を示すが、酸性領域では非常に腐食しやすい。

また、このCℓ・やSО₄\*・等の腐食性アニオンの増加は網もしくは網合金の孔食を発生させる 要因となっている。

即ち、冷却装置の金属材料部分の過大な腐食は 最悪の場合に冷却水の漏洩事故につなかる危険性 がある。

従って、本発明は、冷却装置の金属材料部分の 腐食に関与するPHまたは腐食性アニオンを電子 機器発熱部に到達する前に調整・除去することを 目的とするものである。

#### (課題を解決するための手段)

上記目的は、冷却水を循環経路6を介して循環

#### 〔寒施例〕

以下、本発明の実施例を第1図を用いて詳細に 説明する。

第1図は、本発明の実施例を示す図である。

図において、1 は基板、2 は素子、3 は冷却プレート、4 は循環路、5 はベローズ、6 は循環経路、7 はタンク、8 はポンプ、9 は熱交換器。

10は除イオン交換器 (OH-型). 11はPH センサ、12a. bはソレノイド弁、15は制御 ユニット、16は水質判断手段、17は切替え手段、18はアラームをそれぞれ示す。

なお、図中矢印は冷却水の流れを示すものであ ス

第1図に示される如く、冷却水が所定量貯蓄されたタンク7と、タンク7から調もしくは調合金から構成された循環経路6を介して冷却水を所定 量吐き出すポンプ8と、この冷却水を所定温度まで冷却する熱交換器9から構成されていた。

そして、冷却した冷却水を冷却プレート3内の 循環路4に循環して、電子機器発熱部Aである冷

#### 特開平3-192798 (3)

却プレート3の所定位置から突出してなるベローズ5に対応して基板1上に実装される素子2の冷却を行っていた。

冷却を行った後の冷却水は再度タンクに戻され 終始循環していた。

本発明においては、かかる冷却水が冷却プレート3に供給される前段に、PHセンサ11を設けこのPHセンサ11で現在の冷却水の水質をチェックするようにしている。つまり、PHセンサ11で現在の冷却水における酸性濃度を検出するようにしている。

具体的には、制御ユニット15を構成する水質 判断手段16の判断によってPHが下限規定値以 上である場合には、切替え手段17の制御によっ て降イオン交換器10側のソレノイド弁12bを 閉め、他方のソレノイド弁12aを開放させるこ とにより、冷却水は降イオン交換器10のない系 を循環し電子機器発熱部Aを強制水冷作用する。

一方、 P H センサ l 1 により冷却水の P H が常 に監視されており、長時間使用や炭酸ガスの吸収

イオン交換樹脂が寿命のため、イオン交換器 10へ通水してもPHが回復されない場合は、P Hセンサ11がそれを検知し、アラーム18があ がり、作業者等に除イオン交換樹脂の交換時期を 通知するようにすることが望ましい。

尚、上記実施例においては、P H の規定値は、 上限がP H 1 0 . 下限がP H 7 . 樹脂交換はP H 6 とするのが望ましい。何故ならば、弱アルカリ性(P H 7 ~ 1 0) 水溶液中では、銅表面の酸化皮膜による不動態化がみられ、耐食性が良好なためである。

#### 〔発明の効果〕

以上詳細に説明したように本発明においては、 冷却水のPHを常に監視して悪化の場合は自動的 にイオン交換によるPHの回復を行うので、水質 (PH、腐食性アニオン)を常に良好に雑持する ことができ、水冷システムの信頼性が向上する。 により水質判断手段 1 6 の判断によって P H が下限規定値を下回ると、水質判断手段 1 6 を介した切替え手段 1 7 の制御に基づいて、陰イオン交換器 1 0 側のソレノイド弁 1 2 a を閉口するようにすることによって、陰イオン交換器 1 0 のある系に切り替え

この陰イオン交換器10は、その内部の樹脂が 一例としてOH‐型のもので酸の吸着を行う。

これと同時に、冷却水中のC 2 - や S O 2 - の 腐食性アニオンもO H - 型の陰イオン交換樹脂で イオン交換される。陰イオン交換器 1 0 を 通水す ることにより、O H - が放出されアルカリ領域の 冷却水が生成される。そして、再び P H が上限規 定値以上となったら、互いにソレノイド弁 1 2 a 。 1 2 b が切替え手段 1 7 に基づいて切り替わり、 陰イオン交換器 1 0 のない系を通水する。

こうして、冷却水のPHは規定値範囲内に保たれ、CL・やSO・の腐食性アニオンは常に低濃度に抑えられることになる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例を示す図であり、 第2図は、従来のシステムを示す図である。

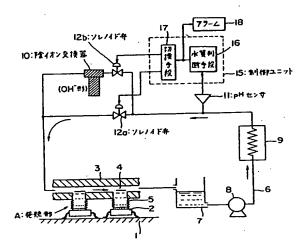
図において、

10 ··············· 除イオン交換器.
11 ············· PHセンサ,
12 a, 12 b ·············· ソレノイド弁.
15 ············ 制御ユニット.
をそれぞれ示す。

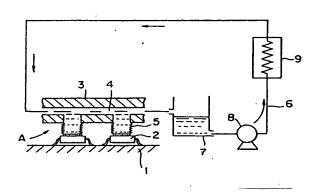
出願人 富士通株式会社

代理人 弁理士 大野隆東 同 弁理士 山川雅

# 特開平3-192798 (4)



本発明の一実施例を示す図 第 1 図



従来のシステムを示す図 第 2 図